特許協力条約

РСТ

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人 の書類記号 AKK-0071-PCT	今後の手続きについては、様式	ハては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。			
国際出願番号 PCT/JP2005/003111	国際出願日 (日. 月. 年) 25. 02. 20	優先日 05 (日.月.年) 25.02.2004			
	22(2006.01), C07C17/16(2006.01) 8(2006.01), H01L51/05(2006.01)	, C07C35/44(2006.01), C07D317/70(2006.01),			
出願人(氏名又は名称)	旭化成株式会社				
1. この報告書は、PCT35条に基づき 法施行規則第57条(PCT36条)の		た国際予備審査報告である。			
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	を含めて全部で7	_ ページからなる。			
3. この報告には次の附属物件も添付され a. ※ 附属書類は全部で 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	-				
	礎とされた及び/又はこの国際予 PCT規則 70.16 及び実施細則第	備審査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 607 号参照)			
第 I 欄 4. 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		出願の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの			
b. 電子媒体は全部で		(電子媒体の種類、数を示す)。			
配列表に関する補充欄に示す。 (実施細則第802号参照)	ように、電子形式による配列表又	は配列表に関連するテーブルを含む。			
4. この国際予備審査報告は、次の内容を	<u></u> を含む。				
第 I 欄 国際予備審查幸	最告の基礎				
第Ⅱ欄 優先権 第Ⅲ欄 新担烘 淮朱州	生又は高紫上の利田可能体について	この国際予備案本却生の不作成			
第Ⅲ欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 第Ⅳ欄 発明の単一性の欠如					
		業上の利用可能性についての見解、それを裏付			
第VI欄ある種の引用ス					
第VII欄 国際出願の不伽 第VII欄 国際出願に対す					
国際予備審査の請求書を受理した日	国際予備審	国際予備審査報告を作成した日			

国際予備審査の請求書を受理した日
04.10.2005国際予備審査報告を作成した日
25.05.2006名称及びあて先
日本国特許庁(IPEA/JP)
郵便番号100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号特許庁審査官(権限のある職員)
品川 陽子4H3554電話番号 03-3581-1101 内線 3443

	I欄	報告の基礎						
1.	1. 言語に関し、この予備審査報告は以下のものを基礎とした。							
		出願時の言語による国際出願						
	-	出願時の言語から次の目的のための言	言語である	語に翻訳された、この国際出願の翻訳文				
		国際調査 (PCT規則12.3(a)及で	び23.1(b))					
		国際公開 (PCT規則12.4(a))	0 10. 1 (0) /					
		国際予備審査 (PCT規則55.2(a	a)又は55.3(a))					
2.	この	報告は下記の出願書類を基礎とした。	(法第6条 (PCT14条) Ø	対規定に基づく命令に応答するために提出され				
	た差	替え用紙は、この報告において「出願	時」とし、この報告に添付し	していない。)				
	mi							
	3	出願時の国際出願書類						
	300	明細書						
	2.1.	21 /14世 目						
		第 1-3, 8-17, 21, 23, 28, 33, 35	ページ、出願時に提出され	れたもの				
		第 4-6, 6/1, 7, 7/1, 18-20, 22, 続きあり	ー ・ページ*、04. 10. 2005	付けで国際予備審査機関が受理したもの				
		 第	ページ*、	付けで国際予備審査機関が受理したもの				
		請求の範囲	_					
	3.403		で ロボカモンディセロン・					
		第 2-9	項、出願時に提出され					
		第 第 1, 10-21, 24-35		規定に基づき補正されたもの 付けで国際予備審査機関が受理したもの				
		第 22, 23	項*、12.05.2006	付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	ann.							
		図面						
			→ジ/図、出願時に提出さ					
			ージ/図*、					
		第 ペ	ージ/図 *、	付けで国際予備審査機関が受理したもの				
	300	配列表又は関連するテーブル						
		配列表に関する補充欄を参照する	5こと。					
3.	,	補正により、下記の書類が削除された	E					
		明細書		~~·>>				
		請求の範囲 第 		項				
		請求の範囲第図面第						
		請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)		項				
		請求の範囲第図面第		項				
		請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	ぶ的に記載すること)	項				
4.	g:	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体		項 ページ/図				
4.	g:	請求の範囲 第 図面 第 配列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体 この報告は、補充欄に示したように、	この報告に添付されかつ以	項				
4.		請求の範囲 第	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c))				
4.	g:	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そまてされたものと認められるので、そ明細書第	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 として作成した。 (PCT規則 70.2(c))				
4.	97	請求の範囲 第 第 図面 第 回列表(具体的に記載すること) 配列表に関連するテーブル(具体 この報告は、補充欄に示したように、えてされたものと認められるので、そ まずである。 第 明細書 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
4.		請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そま説明細書第調求の範囲第図面第	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超 として作成した。 (PCT規則 70.2(c))				
4.	g:	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そ第調報書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
4.		請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、えてされたものと認められるので、それでものと認められるので、それでものと認められるので、それでものを認められるので、それでものを認められるので、それでものを認められるので、それでは、明細書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
4.	,	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そ第調報書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
4.	g:	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そ第調報書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
4.	**************************************	請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そ第調報書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの	項 ページ/図 ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項				
		請求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)配列表に関連するテーブル(具体この報告は、補充欄に示したように、 えてされたものと認められるので、そ第調報書第調求の範囲第図面第配列表(具体的に記載すること)	この報告に添付されかつ以 その補正がされなかったもの 体的に記載すること)	項 ページ/図 で ページ/図 下に示した補正が出願時における開示の範囲を超として作成した。 (PCT規則 70.2(c)) ページ 項 ページ/図 ページ/図				

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

1	見解

新規性(N)	請求の範囲 <u>1-35</u> 請求の範囲	
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲 1-35	
産業上の利用可能性(IA)	請求の範囲 <u>1-35</u> 請求の範囲	

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献:

- (1) WO 03/016599 A1
- (2)日本化学会編,第4版実験化学講座19炭化水素・ハロゲン化合物,丸善,1992, p. 438-446

説明:

(1)請求の範囲1-35に記載された発明について

請求の範囲1-35に記載された発明は、上記文献1、2には記載されていないから新規性を有する。

(2) 請求の範囲1-9 に記載された発明について

請求の範囲1-9 に記載された発明は、上記文献1 により進歩性を有しない。

請求の範囲1 に記載された発明と文献1 に記載された発明とを対比すると、後者の化学式(I)で示される構造式には、前者の化学式(I)で表されるポリアセン化合物が含有されるが、後者には、前者の化学式(I)で表されるポリアセン化合物が具体的に特定されていない点で相違し、その余の点で一致する。

しかしながら、文献1 には、化学式(I)中の R_2 , R_3 , R_7 , R_8 (請求の範囲1 に記載された化学式(I)における R_1 ~ R_4 に相当)に種々の置換基が導入された化合物、及び、化学式(I)中の R_1 , R_4 , R_6 , R_9 (請求の範囲1 に記載された化学式(I)におけるX に相当)にフッ素が置換した化合物がそれぞれ合成方法と共に記載されていること、 R_2 , R_3 , R_7 , R_8 と R_1 , R_4 , R_5 , R_6 , R_9 , R_{10} の双方を官能基とすること(第7 頁22 行~24 行)、及び、これらの化合物が有機半導体薄膜として有用であることが記載されていることから、文献1において、請求の範囲1 に記載された化学式(I)の化合物とすることは、当業者が容易に想到し得るものである。

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 1.2 欄の続き

明細書 04.10.2005 付けで国際調査機関が受理したもの

22/1, 24, 24/1, 25, 25/1, 26, 26/1, 27, 29, 30, 30/1, 31, 32, 32/1, 34, 34/1

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

また、合成の際、置換基の有無や相違に伴う反応温度や試薬等の反応条件の最適化は、当業者が適宜なし得るものである。

次に、請求の範囲1に記載された発明の奏する効果を検討する。

文献1 には、化学式(I)の化合物を用いて形成したトランジスタのキャリア移動度が0.05~0.35cm2/V・s であることが示されており、これらの値を請求の範囲1 に記載された発明の化合物を用いた場合と比較すると、文献1 に記載されたものは、請求の範囲1 に記載された発明のものと同等以上の値であると認められることから、請求の範囲1 に記載された発明の化合物の有するキャリア移動度が顕著な効果を奏するものであるとはいえない。

また、文献1 には、化学式(I)の化合物の薄膜形成方法として、請求の範囲1 に記載された化合物の場合と同程度の濃度の溶液(例えば0.3 重量%)を塗布する方法が記載されていることから、文献1 に記載された化合物と請求の範囲1 に記載された発明の化合物の溶媒に対する溶解性は同等であると認められる。

さらに、本願明細書には、請求の範囲1 に記載された発明の化合物は、分子構造中に ハロゲン元素を有しているため、ハロゲン元素を有していないものと比べて耐酸化性が 優れていることが記載されているが、本願明細書において、かかる効果について具体的 なデータをもって示されておらず、分子構造中のハロゲン元素の耐酸化性に対する作用 効果が不明であるから、請求の範囲1 に記載された発明が、耐酸化性において、予測し 得ない顕著な効果を奏するとはいえない。

請求の範囲2-9 に記載された発明についても同様である。

(3) 請求の範囲10-21 に記載された発明について

請求の範囲10-21 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1 により進歩性を有しない。

文献1 には、化学式(I)の化合物を有する有機半導体薄膜、該化学式(I)の化合物の分子の長軸が基板の表面に対して垂直方向に配向している有機半導体薄膜、該有機半導体薄膜で少なくとも一部を構成した有機半導体素子、及び、トランジスタが記載されている。

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

(4) 請求の範囲22-33 に記載された発明について

請求の範囲22-33 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1、2 により 進歩性を有しない。

文献1 には、5,7,12,14-テトラフルオロペンタセンの製造方法であって、ペンタセンテトロンを還元し、さらにトシル化及びフッ素化する方法が記載されている。

請求の範囲22 に記載された発明と文献1 に記載された発明とを対比すると、前者では1段階目の反応においてポリアセンキノン誘導体を還元してヒドロキシポリアセン誘導体とする方法であるのに対し、後者では、該ヒドロキシポリアセン誘導体について記載されていない点(相違点1)、前者では2段階目の反応において上記のヒドロキシポリアセン誘導体をハロゲン化及び芳香族化する方法であるのに対し、後者では、トシル化及びフッ素化する方法である点(相違点2)、前者では、原料のポリアセンキノン誘導体が化学式(I)における $R_1 \sim R_4$ の少なくとも一部は特定の官能基を有する構造であるのに対し、後者ではかかる官能基を有しない点(相違点3)で相違し、その余の点で一致する。

相違点1 について、文献1 には、上述のとおり、ペンタセンテトロンを還元する方法が記載されていること、及び、通常、カルボニル基を還元することによりヒドロキシ基が生成すると認められることから、文献1 において、ペンタセンテトロンの還元により、対応するヒドロキシポリアセン誘導体が生成しているものと認められる。

相違点2 について、ヒドロキシ基をハロゲン置換してハロゲン化合物を製造する方法として、ヒドロキシ基を直接ハロゲン化する方法、ヒドロキシ基を一旦トシル化し、その後ハロゲン化する方法はいずれも周知であり(文献2)、ヒドロキシ基をハロゲン化する際にヒドロキシ基を一旦トシル化するか否かは、原料の種類や収率、製造方法の効率等を考慮して、当業者が適宜設定し得るものであるところ、文献1に記載のトシル化もヒドロキシ基のハロゲン化のための選択可能な工程であると認められるから、文献1に記載の方法において、トシル化工程を含有しない方法とすることは容易である。

また、文献1には、芳香族化について具体的に記載されていないものの、上記のようにトシル化及びフッ素化により 5,7,12,14-テトラフルオロペンタセンを製造する方法であることから、実質的には、フッ素化と共に芳香族化が行われるものであると認められる。

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

相違点3 について、文献2 には、 R_2 , R_3 , R_7 , R_8 (請求の範囲22 に記載された化学式(I)中の R_1 ~ R_4 に相当)に官能基を有する化合物が具体的に記載されていること、さらに、文献1 に記載された一連の製造工程において、 R_2 , R_3 , R_7 , R_8 がアルキル基等である場合に、還元反応やフッ素化反応がこれらの基に影響を及ぼす理由も認められないことから、文献1 に記載された製造方法において、原料のポリアセンキノン誘導体を、 R_2 , R_3 , R_7 , R_8 の位置の少なくとも一部に官能基を有する化合物とすることは、格別困難なことではない。

その際に、官能基の有無や相違に伴う反応温度や試薬等の反応条件の最適化は、当業者が適宜なし得るものである。

請求の範囲23-33 に記載された発明についても同様である。

(5)請求の範囲34、35 に記載された発明について

請求の範囲33、34 に記載された発明は、国際調査報告で引用された文献1 により進 歩性を有しない。

文献1 には、多数の画素面を備えるディスプレイ装置であって、化学式(I)で示された化合物を含有する有機半導体薄膜で構成した有機半導体素子又はトランジスタを各画素に設けたディスプレイ装置が記載されている。

また、文献1 には、有機半導体素子又はトランジスタが備える電極、誘電体層、及び半導体層を、液体の印刷又は塗布により形成したディスプレイ装置が記載されている。

オキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、化学式(I)中の複数のXのうち一部且つ2個以上がハロゲン基であり、他部は水素原子である。さらに、kは1以上5以下の整数である。

[0015] ここで、 R_3 , R_4 は水素原子であることが好ましい。

[0016] また、 R_1 , R_2 と R_3 , R_4 との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成していることが 好ましい。

[0017] さらに、 R_{1} , R_{2} , R_{3} , R_{4} のうち官能基の炭素数は1以上15以下であることが好ましく、2以上15以下であることが特に好ましい。

[0018] さらに、複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが好ましい。そして、複数のXのうち2個がハロゲン基であり、これら2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが特に好ましい。

[0019] さらに、kは1又は2であることが好ましい。

[0020] さらに、本発明の有機半導体薄膜は、下記の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物で構成され、結晶性を有することを特徴とする。 [化2]

$$R_1$$
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

ただし、化学式(I)中の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち少なくとも一部は、アルキル基, アルケニル基, アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカ

ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、化学式(I)中の複数のXのうち一部はハロゲン基であり、他部は水素原子である。さらに、kは1以上5以下の整数である。

ここで、化学式(I)中の R_3 , R_4 は水素原子であることが好ましい。また、 R_1 , R_2 と R_3 , R_4 との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成している ことが好ましい。さらに、 R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち官能基の炭素数は1以上 15以下であることが好ましく、2以上15以下であることがより好ましく、 2以上6以下であることが特に好ましい。さらに、複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが好ましい。そして、複数のXのうち2個がハロゲン基であり、 これら2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが特に好ましい。 さらに、X は1X は2X であることが好ましい。

この有機半導体薄膜は、基板上に形成された結晶性の有機半導体薄膜であって、前記ポリアセン化合物の分子の長軸が前記基板の表面に対して垂直方向に配向していることが好ましい。

- [0021] さらに、本発明の有機半導体素子は、前述した本発明の有機半導体薄膜で少なくとも一部を構成したことを特徴とする。
- [0022] さらに、本発明のトランジスタは、ゲート電極,誘電体層,ソース電極,ドレイン電極,及び半導体層を備えるトランジスタにおいて、前記半導体層を前述した本発明の有機半導体薄膜で構成したことを特徴とする。
- [0023] さらに、本発明のポリアセン化合物の製造方法は、ポリアセンキノン誘導体を還元してヒドロキシポリアセン誘導体とし、さらにこのヒドロキシポリアセン誘導体をハロゲン化及び芳香化することにより、前述の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物を製造する方法であって、前記ポリアセンキノン誘導体は、前述の化学式(I)のポリアセン化合物に対応する化

学構造を有する化合物であって、同一の六員環数及び同一の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 を備えるとともに、ポリアセン化合物となった際にハロゲン基と結合する 炭素原子が、キノンのカルボニル炭素となっており、前記ヒドロキシポリアセン誘導体は、前述の化学式(I)のポリアセン化合物に対応する化学構造を有する化合物であって、同一の六員環数及び同一の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 を備えるとともに、ポリアセン化合物となった際にハロゲン基と結合する炭素原子が、水酸基及び水素原子と結合していることを特徴とする。

[0024] さらに、本発明のポリアセン化合物の製造方法は、前述の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物を製造する方法であって、下記の化学式(II)で表されるような構造を有するポリアセンキノン誘導体を還元して、下記の化学式(III)で表されるような構造を有するヒドロキシポリアセン誘導体とし、さらにこのヒドロキシポリアセン誘導体をハロゲン化及び芳香化することを特徴とする。

[他3]

$$R_1$$
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

[0026] [化4]

$$R_1$$
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_2
 R_4
 R_4
 R_5
 R_4
 R_6
 R_1
 R_4
 R_5
 R_4
 R_6
 R_7

[0027] ただし、化学式(II)及び化学式(III)中の R_1 、 R_2 , R_3 , R_4 のうち少なくとも一部は、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、化学式(II)及び化学式(III)中の X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 はそれのロゲン基又は水素原子である。ただし、 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_5 の全てがハロゲン基である場合を除く。さらに、mは2以上の整数であり、m+nは3以上7以下の整数である。

ここで、化学式(I)中のR $_3$, R $_4$ は水素原子であることが好ましい。また、R $_1$, R $_2$ とR $_3$, R $_4$ との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成していることが好ましい。さらに、R $_1$, R $_2$, R $_3$, R $_4$ のうち官能基の炭素数は1以上15以下であることが好ましく、2以上15以下であることがより好ましく、2以上6以下であることが特に好ましい。さらに、複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが好ましい。そして、複数のXのうち2個がハロゲン基であり、これち2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることが特に好ましい。さらに、kは1又は2であることが好ましい。

[0028] さらに、本発明のヒドロキシポリアセン誘導体は、下記の化学式 (IV) で表されるような構造を有するポリアセンに対応する化学構造を有するヒドロキシポリアセン誘導体であって、同一の六員環数及び同一のR₁,R₂,R₃,R₄を備えるとともに、前記ポリアセンにおいてR₁,R₂,R₃,R₄が結合している炭素原子以外の炭素原子のうち少なくとも一つが、水酸基及び水素原子と結合している構造を有することを特徴とする。

日本国特許庁 04.10.2005

[0029] [化5]

$$R_2$$
 R_3
 R_4

(IV)

- [0030] ただし、化学式(IV)中のR₁,R₂,R₃,R₄のうち少なくとも一部は、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、kは1以上5以下の整数である。
- [0031] さらに、本発明のヒドロキシポリアセン誘導体は、上記の化学式(III)で表されるような構造を有することを特徴とする。

さらに、本発明のディスプレイ装置は、多数の画素からなる画素面を備えるディスプレイ装置において、前記各画素は、前述した本発明の有機半導体素子又は前述した本発明のトランジスタを備えることを特徴とする。

なお、前記有機半導体素子又は前記トランジスタが備える電極、誘電体層、及び半導体層を、液体の印刷又は塗布によって形成することが好ましい。

- [0032] 本発明のポリアセン化合物は、細長い形のポリアセン骨格の長軸方向の端部(一方又は両方の端部)に官能基を有し、且つ、側面部分にハロゲン基を有する構造である。本発明者らは、ポリアセン化合物の長軸方向の端部に官能基を導入することによって、溶媒に対する溶解性が向上し、側面部分にハロゲン基を導入することによって、耐酸化性が向上すると考え、前記化学式(1)で表されるような構造を有する新規なポリアセン化合物を発明するに至った。
- [0033] そして、本発明のポリアセン化合物及びその薄膜は、従来の有機材料中で最も高い移動度を有するペンタセンと同程度又はそれを超える高い移動度を発現すること

7/1

日本国特許扩 (4.10.2005)

を見出した。また、常温において溶媒に対する溶解性が乏しいペンタセンと比べて、本発明のポリアセン化合物は溶解性が優れていること、及び、耐酸化性が優れていることを見出した。さらに、本発明のポリアセン化合物の薄膜を用いた有機半導体素子は、優れた電子特性を示すことを見出した。

対象物を接触又は隣接させた際に生じる有機半導体薄膜の抵抗値の変化によって、 、測定対象物の分析を行うことができる。

[0087] 以下に、実施例を示して、本発明をさらに具体的に説明する。

[0088] [実施例1:6, 13-ジクロロー2, 3, 9, 10-テトラヘキシルペンタセンの合成] [中間体の合成方法について]

2, 3, 9, 10-テトラヘキシルー6, 13-ペンタセンキノン649mgをテトラヒドロフラン (THF) 30mlに溶解させた溶液に、水素化リチウムトリエチルボレートのTHF溶液 (濃度は1mol/1000ml)を5ml加え、窒素雰囲気下で12時間加熱還流させた。得られた溶液に希塩酸を加えて中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、2, 3, 9, 10-テトラヘキシルー6, 13-ジヒドロー6, 13-ジヒドロー6,

[0089][化 6]

[0090] 得られた 2, 3, 9, 10 - \overline{y} トラヘキシルー 6, 13 - ジヒドロー 6, 1 3 - ジヒドロキシペンタセンについて、

質量分析を行った。結果は以下の通りである。

[0091] FAB-MS (NBA): m/z = 649

また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。

[0092] H-NMR (ppm): 80. 88及び0,91 (m, 12H)、1,32及び1.35 (m, 16H)、1.48及び1.52(m, 8H)、1.63及び1.67(m, 8H)、2.75(t, 8H)、5.74(s, 2H)、7. 58 (s, 4H)、7. 80 (s, 4H)

〔ポリアセン化合物の製造方法について〕

窒素雰囲気下において、 $N-\rho$ ロロスクシンイミド382mgをジクロロメタン40mlに溶解させ、-20 Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.32mlを滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、2,3,9,10-テトラヘキシル-6,13-ジヒドロ-6,13-ジヒドロキシペンタセン231mgをジクロロメタン20mlに溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇湿して18時間反応させた(上記の反応式を参照)。

- [0093] 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 圧留去し、得られた残渣をベンゼンとローへキサンとの混合溶媒から再沈殿を行うと、 純粋な6,13-ジクロロー2,3,9,10-テトラへキシルペンタセン74mgが得られた 。この反応における収率は30%であった。
- [0094] 得られた6, 13ージクロロー2, 3, 9, 10ーテトラヘキシルペンタセンについて、質量分析を行った。結果は以下の通りである。
- [0095] FAB-MS(NBA); m/z=684, 682 また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定を行った。結果を以下に示し、得られたチャートを図1に示す。
- [0096] ¹H-NMR(ppm): 80、90及び0.93(m, 12H)、1.35及び1.39(m, 16H)、1.48及び1.50(m, 8H)、1.71及び1.80(m, 8H)、2.77(t, 8H)、7.76(s, 4H)、9、01(s, 4H)

[有機半導体薄膜の製造方法について]

前述のようにして合成した6、13-ジクロロー2、3、9、10-テトラヘキシルペンタセ

- 0ml)を11ml加え、窒素雰囲気下で24時間加熱還流させた。得られた溶液に希塩酸を加えて中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、6,13ージヒドロー6,13ージヒドロキシー2,3,9,10ーテトラプロピルペンタセンをほぼ定量的に得た。
- [0102] 得られた6,13-ジヒドロ-6,13-ジヒドロキシ-2,3,9,10 -テトラプロピルペンタセンについて、重水素化クロロホルムを溶媒として用 いて、室温にて核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定を行った。結果を以下に 示す。
- [0103] 1 H-NMR (ppm): δ 1.05(t, 12H), 1.67~1.77(m, 8H), 2.76(t, 8H), 5.78(s, 2H), 7.61(s, 4H), 7.81(s, 4H)

〔ポリアセン化合物の製造方法について〕

窒素雰囲気下において、N-クロロスクシンイミド800mgをジクロロメタン45mlに溶解させ、 -20° Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.66mlを滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、6, 13-ジヒドロ-6, 13-ジヒドロキシ-2, 3, 9, 10-テトラプロピルペンタセン361mgをジクロロメタン35mlに溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

- [0104] 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 圧留去し、得られた残渣をベンゼンから再沈殿を行うと、純粋な6,13-ジクロロー2 ,3,9,10-テトラプロピルペンタセン38mgが得られた。この反応における収率は1 0%であった。
- [0105] 得られた6, 13ージクロロー2, 3, 9, 10ーテトラプロピルペンタセンについて、質量 分析を行った。結果は以下の通りである。
- [0106] FAB-HRMS (NBA): m/z=514. 2208 (計算値=514. 2194)
 また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0107] 1 H-NMR(ppm): δ 1.08(t, 12H), 1.73~1.82(m, 8H), 2.76(t, 8H), 7. 76 (s, 4H), 9. 01 (s, 4H)

22/1

日本国特許庁 04.10.2005

〔有機半導体薄膜の製造方法について〕

前述のようにして合成した6,13ージクロロー2,3,9,10ーテトラプロピルペンタセ

1加え、窒素雰囲気下で20時間加熱還流させた。得られた溶液に希塩酸を加えて中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、6、13ージヒドロー6、13ージヒドロキシー2、3ージプロピルペンタセンをほぼ定量的に得た。

[0113] [ポリアセン化合物の製造方法について]

窒素雰囲気下において、Nークロロスクシンイミド1.0gをジクロロメタン60mlに溶解させ、-20℃に冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.83mlを滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、6,13-ジヒドロー6,13-ジヒドロキシー2,3-ジプロピルペンタセン317mgをジクロロメタン50mlに溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

- [0114] 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 圧留去し、得られた残渣をエタノールから再沈殿を行うと、純粋なら、13-ジクロロー 2、3-ジプロピルペンタセン17mgが得られた。この反応における収率は5%であっ た。
- [0115] 得られた6, 13-ジクロロー2, 3-ジプロピルペンタセンについて、質量分析を行った。結果は以下の通りである。
- [0116] FAB-HRMS (NBA): m/z=430. 1258 (計算値=430. 1255) また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0117] H-NMR(ppm): δ 1.08(t, 6H)、1.73~1.82(m, 4H)、2.75(t, 4H)、7.38(dd, 2H)、7.75(s, 2H)、7.99(dd, 2H)、9.00(s, 2H)、9.11(s, 2H)(有機半導体薄膜の製造方法について)

前述のようにして合成した6、13-ジクロロー2、3-ジプロピルペンタセンを窒素雰囲気中でトルエンに溶解し、青紫色の溶液(濃度は0.2質量%)を得た。該溶液を窒素雰囲気中でシリコン基板上にスピンコート(回転速度:1000rpm、回転時間:10秒間)して、膜厚80nmの6、13-ジクロロー2、3-ジプロピルペンタセン薄膜を形成した。

24/1

日本周特許庁 04.10,2005

[0118] 得られた 6, 13 - ジクロロー 2, 3 - ジプロピルペンタセン薄膜を広角 X線回折法に

より分析した結果、 $(0\ 0\ n)$ 面に相当する回折線(n=1,2,3,4)が観測され、この面間距離により薄膜の結晶格子定数は $2.4\ n$ mであることが分かった。 $6,1\ 3$ - ジクロロー2、3 - ジプロピルペンタセン分子の長軸方向の長さが 2. 0 - 2. $4\ n$ mであることから、6, $1\ 3$ - ジクロロー2、3 - ジプロピルペンタセン分子は薄膜内において、分子の長軸を基板の表面に対して垂直方向に配向させて結晶を形成していることが分かった。

[0119] 〔有機半導体素子について〕

n型ドーパントでヘビードープされたシリコン基板(厚さ200nmの熱酸化膜を表面に備えた基板)の表面に、ソース・ドレイン電極として金電極のパターンを形成した。この金電極のパターンは、短冊状のパターンが並行に形成されているものであり、パターン間(チャネル長)は50 μ m、パターン長さ(チャネル幅)は500 μ mである。

- [0120] このような電極パターンが形成されたシリコン基板上に、上記と同様のスピンコートにより 6, 13 ジクロロー 2, 3 ジプロピルペンタセン薄膜を形成し、トランジスタ構造とした。
- [0121] 該トランジスタのシリコン基板をゲートとして、ソース・ドレイン電極間の電流/電圧 曲線を測定した。その際には、ゲート電圧を-10Vから-40Vまで、10Vステップで 変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測され た。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、0.10cm²/V・s であった。
- [0122] [実施例 4 : 6, 1 3 ジクロロー 2, 3 ジヘキシルペンタセンの合成] [中間体の合成方法について]

2、3ージへキシルー6、13ーペンタセンキノン334mgをTHF50mlに溶解させた 溶液に、水素化リチウムトリエチルボレートのTHF溶液濃度は1mol/1000ml)を1 1ml加え、窒素雰囲気下で20時間加熱還流させた。得られた溶液に希塩酸を加え て中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、2、3 ージへキシルー6、13ージヒドロー6、13ージヒドロキシペンタセンをほ ぼ定量的に得た。

[0123] [ポリアセン化合物の製造方法について]

日本国特許庁 04.10.2005

窒素雰囲気下において、Nークロロスクシンイミド780mgをジクロロメタン40mlに溶

解させ、-20℃に冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.64m1を滴下した後、10分 撹拌した。得られた溶液に、2,3-ジヘキシル-6,13-ジヒドロ-6, 13-ジヒドロキシペンタセン336mgをジクロロメタン40m1に溶解 させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応さ せた。

- | 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を | 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 | 圧留去し、得られた残渣をエタノールから再沈殿を行うと、純粋な6,13-ジクロロー | 2,3-ジヘキシルペンタセン35mgが得られた。この反応における収率は10%であった。
- 得られた 6, 13 ージクロロー 2, 3 ージヘキシルペンタセンについて、質量分析を行 [0125] った。結果は以下の通りである。
- [0126] FAB-HRMS (NBA): m/z=514.2193 (計算値=514.2194). また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0127] H-NMR(ppm): δ0, 92(t, 6H), 1,30~1.50(m, 12H), 1.68~1.76(m, 4H), 2.74(t, 4H), 7.37(dd, 2H), 7.71(s, 2H), 7.98(dd, 2H), 8.9 6 (s, 2H), 9, 08 (s, 2H)

[有機半導体薄膜の製造方法について]

前述のようにして合成した6,13-ジクロロー2,3-ジヘキシルペンタセンを窒素雰囲気中でトルエンに溶解し、青紫色の溶液(濃度は0.2質量%)を得た。該溶液を窒素雰囲気中でシリコン基板上にスピンコート(回転速度:1000rpm、回転時間:10秒間)して、膜厚100nmの6,13-ジクロロー2,3-ジヘキシルペンタセン薄膜を形成した。

[0128] 得られた 6, 13 - ジクロロー2, 3 - ジヘキシルペンタセン薄膜を広角 X線回折法により分析した結果、(00 n) 面に相当する回折線 (n=1, 2, 3, 4) が観測され、この面間距離は1, 1 nmであることが分かった。6, 13 - ジクロロー2, 3 - ジヘキシルペンタセン分子の長軸方向の長さが2, 2~2, 5 nmであることから、6, 13 - ジクロロー2, 3

ージへキシルペンタセン分子は薄膜内において、分子の長軸を基板の表面に対して

垂直方向に配向させて結晶を形成していることが推定される。

[0129] [有機半導体素子について]

n型ドーパントでヘビードープされたシリコン基板(厚さ200nmの熱酸化膜を表面に備えた基板)の表面に、ソース・ドレイン電極として金電極のパターンを形成した。この金電極のパターンは、短冊状のパターンが並行に形成されているものであり、パターン間(チャネル長)は50μm、パターン長さ(チャネル幅)は500μmである。

- [0130] このような電極パターンが形成されたシリコン基板上に、上記と同様のスピンコート により 6, 13 ジクロロー 2, 3 ジヘキシルペンタセン薄膜を形成し、トランジスタ構造とした。
- [0131] 該トランジスタのシリコン基板をゲートとして、ソース・ドレイン電極間の電流/電圧 曲線を測定した。その際には、ゲート電圧を一10Vから-40Vまで、10Vステップで 変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測され た。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、9×10 cm /V・ s であった。
- [0132] [実施例5:6,13-ジブロモー2,3,9,10-テトラヘキシルペンタセンの合成] (中間体の合成方法について)

実施例1と同様にして、2,3,9,10ーテトラヘキシルー6,13ージヒドロー6, 13ージヒドロキシペンタセンを得た。

[0133] [ポリアセン化合物の製造方法について]

窒素雰囲気下において、Nーブロモスクシンイミド338mgをTHF20mlに溶解させ、-20℃に冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.20mlを滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、2,3,9,10ーテトラヘキシルー6,13ージヒドロー6,13ージヒドロキシペンタセン150mgをTHF10mlに溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

[0134] 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 圧留去し、得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(溶媒としては、ベンゼ ンとヘキサンとの混合溶媒を用いた)にて精製を行うと、純粋な6, 13-ジブロモ-2 により 6, 13 - ジブロモー 2, 3, 9, 10 - テトラヘキシルペンタセン薄膜を形成し、トランジスタ 構造と した。

- [0141] 該トランジスタのシリコン基板をゲートとして、ソース・ドレイン電極間の電流/電圧 曲線を測定した。その際には、ゲート電圧を-10Vから-40Vまで、10Vステップで 変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測された。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、0.014cm²/V・s であった。
- [0142] [実施例6:6,13-ジブロモー2,3,9,10-テトラプロピルペンタセンの合成] [中間体の合成方法について]

実施例 2 と同様にして、6, 13 ージヒドロー6, 13 ージヒドロキシー2, 3, 9, 10 ーテトラプロピルペンタセンを得た。

[0143] [3143] [3143] [3143] [3143] [3143] [3143] [3143] [3143]

窒素雰囲気下において、N-プロモスクシンイミド462mgをTHF20m1に溶解させ、-20°Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.28m1を滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、6,13-ジヒドロ-6,13-ジヒドロキシ-2,3,9,10-テトラプロピルペンタセン150mgをTHF15m1に溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

- [0144] 有機溶媒を減圧留去し、残渣にnーヘキサンを加えてろ過した。そして、その残渣をアセトニトリルで洗浄し、さらにnーヘキサンとベンゼンの1:1混合溶媒で洗浄すると、純粋な6,13-ジブロモー2,3,9,10-テトラプロピルペンタセン37mgが得られた。この反応における収率は20%であった。
- [0145] 得られた6, 13-ジブロモ-2, 3, 9, 10-テトラプロピルペンタセンについて、質量分析を行った。結果は以下の通りである。
- FAB-HRMS(NBA): m/z=606,604,602
 [0146] また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴(NMR)スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0147] 1 H-NMR(ppm): δ 1.07(t, 12H), 1.75~1.78(m, 8H), 2.76(t, 8H), 7. 77 (s, 4H), 9. 06 (s, 4H)

〔有機半導体薄膜の製造方法について〕

前述のようにして合成した6,13ージプロモー2,3,9,10ーテトラプロピルペンタセンを窒素雰囲気中でトルエンに溶解し、青紫色の溶液(濃度は0.2質量%)を得た。 該溶液を窒素雰囲気中でシリコン基板上に展開して、膜厚100nmの6,13ージブロモー2,3,9,10ーテトラプロピルペンタセン薄膜を形成した。

- [0148] 得られた6, 13-ジブロモー2, 3, 9, 10-テトラプロビルベンタセン薄膜を広角X線回折法により分析した結果、(00n)面に相当する回折線(n=1, 2, 3, 4)が観測され、この面間距離により薄膜の結晶格子定数は2. 4 nmであることが分かった。6, 13-ジブロモー2, 3, 9, 10-テトラプロビルベンタセン分子の長軸方向の長さが2. 2~2. 4 nmであることから、6, 13-ジブロモー2, 3, 9, 10-テトラプロビルベンタセン分子は薄膜内において、分子の長軸を基板の表面に対して垂直方向に配向させて結晶を形成していることが分かった。
- [0149] 〔有機半導体素子について〕

n型ドーパントでヘビードープされたシリコン基板(厚さ200nmの熱酸化膜を表面に備えた基板)の表面に、ソース・ドレイン電極として金電極のパターンを形成した。この金電極のパターンは、短冊状のパターンが並行に形成されているものであり、パターン間(チャネル長)は50μm、パターン長さ(チャネル幅)は500μmである。

- [0150] このような電極パターンが形成されたシリコン基板上に、上記と同様にして6,13-ジプロモー2,3,9,10-テトラプロピルペンタセン薄膜を形成し、トランジスタ構造とした。
- [0151] 該トランジスタのシリコン基板をゲートとして、ソース・ドレイン電極間の電流/電圧 曲線を測定した。その際には、ゲート電圧を一10Vから一40Vまで、10Vステップで 変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測された。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、0.05cm²/V・s であった。
- [0152] [実施例7:6, 13ージプロモー2, 3ージプロピルペンタセンの合成] [中間体の合成方法について]

実施例3と同様にして、6、13ージヒドロー6、13ージヒドロキシー2、3ージプロピ

日本国特許庁 04.10.2005

ルペンタセンを得た。

[0153] [ポリアセン化合物の製造方法について]

窒素雰囲気下において、N-プロモスクシンイミド552mgをTHF20m1に溶解させ、-20°Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.33m1を滴下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、6,13-ジヒドロ-6,13-ジヒドロキシ-2,3-ジプロピルペンタセン150mgをTHF15m1に溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

- [0154] 有機溶媒を減圧留去し、残渣にn-ヘキサンを加えてろ過した。そして、その残渣をn-ヘキサンとベンゼンの5:1混合溶媒で洗浄し、さらにアセトニトリルで洗浄すると、純粋な6,13-ジプロモー2,3-ジプロピルペンタセン30mgが得られた。この反応における収率は15%であった。
- [0155] 得られた 6, 13 ージブロモー 2, 3 ージプロピルペンタセンについて、質量分析を行った。結果は以下の通りである。
- [0156] FAB-HRMS (NBA): m/z=522, 520, 518 また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0157] H-NMR(ppm): δ 1.0 9(t, 6H)、1.76~1.8 2(m, 4H)、2.7 7(t, 4H)、7.4 0(dd, 2H)、7.7 9(s, 2H)、8.0 2(dd, 2H)、9.1 0(s, 2H)、9.2 0(s, 2H)、信機半導体薄膜の製造方法について]

前述のようにして合成した 6, 13-ジブロモー2, 3-ジプロピルペンタセンを窒素雰囲気中でクロロホルムに溶解し、青紫色の溶液(濃度は 0.2質量%)を得た。該溶液を窒素雰囲気中でシリコン基板上に展開して、膜厚 120 nmの 6, 13-ジブロモー2, 3-ジプロピルペンタセン薄膜を形成した。

[0158] 得られた6, 13-ジブロモー2, 3-ジプロピルペンタセン薄膜を広角 X線回折法により分析した結果、(00n) 面に相当する回折線(n=1, 2, 3, 4) が観測され、この面間距離により薄膜の結晶格子定数は2. 4nmであることが分かった。6, 13-ジブロモー2, 3-ジプロピルペンタセン分子の長軸方向の長さが2. 0~2. 4nmであることから、6, 13-ジブロモー2, 3-ジプロピルペンタセン分子は薄膜内において、分子の長軸を基板の表面に対して垂直方向に配向させて結晶を形成していることが分か

った。

[0159] [有機半導体素子について]

n型ドーパントでヘビードープされたシリコン基板(厚さ200n mの熱酸化膜を表面に備えた基板)の表面に、ソース・ドレイン電極として金電極のパターンを形成した。この金電極のパターンは、短冊状のパターンが並行に形成されているものであり、パターン間(チャネル長)は 500μ m、パターン長さ(チャネル幅)は 500μ mである。

- [0160] このような電極パターンが形成されたシリコン基板上に、上記と同様にして6,13-ジプロモー2,3-ジプロピルペンタセン薄膜を形成し、トランジスタ構造とした。
- [0161] 該トランジスタのシリコン基板をゲートとして、ソース・ドレイン電極間の電流/電圧 曲線を測定した。その際には、ゲート電圧を一10Vから-40Vまで、10Vステップで 変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測され た。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、0.13cm²/V・s であった。
- [0162] [実施例8:6,13-ジクロロー2,3-ジェチルペンタセンの合成] [中間体の合成方法について]

2,3ージエチルー6,13ーペンタセンキノン150mgをTHF30mlに溶解させた溶液に、水素化リチウムトリエチルボレートのTHF溶液(濃度は1mol/1000ml)を3.2ml加え、窒素雰囲気下、室温で2時間反応させた。得られた溶液に希塩酸を加えて中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、2,3ージエチルー6,13ージヒドロー6,13ージヒドロキシペンタセンをほぼ定量的に得た。

[0163] 〔ポリアセン化合物の製造方法について〕

窒素雰囲気下において、Nークロロスクシンイミド300mgをジクロロメタン40mlに溶解させ、 -20° Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィド0.3mlを滴下した後、10分 撹拌した。得られた溶液に、2,3-ジェチル-6,13-ジヒドロ-6,13-ジヒドロキシペンタセン75mgをTHF4mlに溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

[0164] 有機溶媒を減圧留去し、残渣をアセトニトリルで念入りに洗浄すると、純粋な6,13

日本国特許庁 04.10.2005

ージクロロー2、3ージエチルペンタセン25mgが得られた。この反応における収率は

変化させた。その結果、ドレイン電圧の増加に伴ってドレイン電流の飽和が観測された。この電流飽和領域のゲート電圧依存性から求めた移動度は、 5×10^{-4} cm /V・s であった。

[0172] 〔実施例9:6,13-ジクロロー2,3-(メチレンジオキシ)ペンタセンの合成〕 [中間 体の合成方法について]

2,3-メチレンジオキシー6,13-ペンタセンキノン57mgをTHF25mlに溶解させた溶液に、水素化リチウムトリエチルボレートのTHF溶液(濃度は1mol/1000ml)を1.6ml加え、窒素雰囲気下、室温で1時間反応させた。得られた溶液に希塩酸を加えて中和した後に、有機相を分離、濃縮、及び真空乾燥することにより、6,13-ジヒドロー6,13-ジヒドロキシー2,3-(メチレンジオキシ)ペンタセンをほぼ定量的に得た。

[0173] [ポリアセン化合物の製造方法について]

窒素雰囲気下において、N-クロロスクシンイミド250mgをジクロロメタン40m1に溶解させ、-20 Cに冷却した。そして、ジメチルスルフィドの、3m1を簡下した後、10分撹拌した。得られた溶液に、6, 13-ジヒドロ-6, 13-ジヒドロキシー2, 3-(メチレンジオキシ)ペンタセン57mgをTHF3m1に溶解させた溶液を滴下し、滴下終了後ゆっくりと室温まで昇温して18時間反応させた。

- [0174] 水を加えて反応を終了させたら、クロロホルムで反応生成物等を抽出し、有機相を 飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥した。有機相中の有機溶媒を減 圧留去し、得られた残渣をアセトニトリルから再沈殿を行うと、純粋な6,13-ジクロロ -2,3-(メチレンジオキシ)ペンタセン8mgが得られた。この反応における収率は1 3%であった。
- [0175] 得られた 6 , 13-ジクロロー 2 , 3- (メチレンジオキシ) ペンタセンについて、質量分析を行った。結果は以下の通りである。
- [0176] FAB-HRMS (NBA): m/z=392、390
 また、重水素化クロロホルムを溶媒として用いて、室温にて核磁気共鳴 (NMR) スペクトル測定を行った。結果を以下に示す。
- [0177] 1 H-NMR(ppm): δ 6.09(s, 2H), 7.21(s, 2H), 7.43(dd, 2H), 8.04(d

34/1

日本国特許庁 04.10.2005

d, 2H), 8.90(s, 2H), 9.16(s, 2H)

日本国特許庁 04.10.2005

請求の範囲

[1](補正後) 下記の化学式(I)で表されるような構造を有することを特徴とするポリアセン化合物。 [化7]

ただし、化学式(I)中のR₁,R₂,R₃,R₄のうち少なくとも一部は、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、化学式(I)中の複数のXのうち一部且つ2個以上がハロゲン基であり、他部は水素原子である。さらに、kは1以上5以下の整数である。

- [2] $R_{a,j}R_{a}$ が水素原子であることを特徴とする請求項1に記載のポリアセン化合物。
- [3] R₁,R₂とR₃,R₄との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成していることを特徴とする請求項1に記載のポリアセン化合物。
- [4] R_1, R_2, R_3, R_4 のうち官能基の炭素数が1以上15以下であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれか一項に記載のポリアセン化合物。
- [5] R_1, R_2, R_3, R_4 のうち官能基の炭素数が2以上15以下であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれか一項に記載のポリアセン化合物。
- [6] R_1, R_2, R_3, R_4 のうち官能基の炭素数が 2以上 6以下であることを特徴とする請求項 $1\sim3$ のいずれか一項に記載のポリアセン化合物。

- [7] 複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のポリアセン化合物。
- [8] 複数のXのうち2個がハロゲン基であり、これら2個のハロゲン基が同一のアセン環 に結合していることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のポリアセン化 合物。
- [9] kが1又は2であることを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載のポリアセン化合物。
- [10](補正後) 下記の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物で構成され、 結晶性を有することを特徴とする有機半導体薄膜。
 [化8]

$$R_1$$
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4

ただし、化学式(I)中の R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 のうち少なくとも一部は、Tルキル基、Tルケニル基、Tルキニル基等の脂肪族炭化水素基、Tリール基、Tルコキシ基、Tリールオキシ基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、T1、T2、T3、T3、T4、T5 、T5 、T5 、T5 、T5 、T5 、T7 、T7 、T8 、T9 、T

- [11](補正後) R₃,R₄が水素原子であることを特徴とする請求項10に記載の有機半導体 薄膜。
- [12](補正後) R_1, R_2 と R_3, R_4 との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成していることを特徴とする請求項10に記載の有機半導体薄膜。

 R_3 , R_4 を備えるとともに、前記ポリアセンにおいて R_1 , R_2 , R_3 , R_4 が結合している炭素原子以外の炭素原子のうち少なくとも一つが、水酸基及び水素原子と結合している構造を有することを特徴とするヒドロキシポリアセン誘導体。

[化13]

(IV)

ただし、化学式(IV)中のR₁, R₂, R₃, R₄のうち少なくとも一部は、アルキル基, アルケニル基, アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、kは1以上5以下の整数である。

[33](追加) 下記の化学式(III)で表されるような構造を有することを特徴とするヒドロキシポリアセン誘導体。

[化14]

$$R_1$$
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4

ただし、化学式(III)中の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち少なくとも一部は、アルキル基, アルケニル基, アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボ

ニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。また、化学式(III)中の X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 はそれぞれハロゲン基又は水素原子である。ただし、 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 の全でがハロゲン基である場合を除く。さらに、mは2以上の整数であり、m+nは3以上7以下の整数である。

- [34](追加) 多数の画素からなる画素面を備えるディスプレイ装置において、前記各画素は、 請求項20に記載の有機半導体素子又は請求項21に記載のトランジスタを備え ることを特徴とするディスプレイ装置。
- [35](追加) 前記有機半導体素子又は前記トランジスタが備える電極, 誘電体層, 及び半導体層を、液体の印刷又は塗布によって形成したことを特徴とする請求項34に記載のディスプレイ装置。

- [13] R₁, R₂, R₃, R₄のうち官能基の炭素数が1以上15以下であることを特徴とする請求項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [14] R₁, R₂, R₃, R₄のうち官能基の炭素数が2以上15以下であることを特徴とする請求項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [15] R₁, R₂, R₃, R₄のうち官能基の炭素数が2以上6以下であることを特徴とする請求 項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [16] 複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることを特徴とする請求項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [17] 複数のXのうち2個がハロゲン基であり、これら2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることを特徴とする請求項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [18] kが1又は2であることを特徴とする請求項10~12のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [19] 基板上に形成された結晶性の有機半導体薄膜であって、前記ポリアセン化合物の分子の長軸が前記基板の表面に対して垂直方向に配向していることを特徴とする請求項10~18のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜。
- [20] 請求項10~19のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜で少なくとも一部を構成したことを特徴とする有機半導体素子。
- [21] ゲート電極,誘電体層,ソース電極,ドレイン電極,及び半導体層を備えるトランジスタにおいて、前記半導体層を請求項10~19のいずれか一項に記載の有機半導体薄膜で構成したことを特徴とするトランジスタ。
- [22](補正後)ポリアセンキノン誘導体からポリアセン化合物を2段階の反応で製造する方法であり、

1段階目の反応において、ポリアセンキノン誘導体を還元してヒドロキシポリアセン誘導体とし、2段階目の反応において、このヒドロキシポリアセン誘導体をハロゲン化及び芳香化して、下記の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物とする方法であって、

前記ポリアセンキノン誘導体は、前記ポリアセン化合物に対応する化学構造を有する化合物であって、同一の六員環数及び同一の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 を備えるとともに、ポリアセ

12, 5, 2006

ン化合物となった際にハロゲン基と結合する炭素原子が、キノンのカルボニル炭素となって おり、

前記ヒドロキシポリアセン誘導体は、前記ポリアセン化合物に対応する化学構造を有する 化合物であって、同一の六員環数及び同一の R_1 , R_2 , R_3 , R_4 を備えるとともに、ポリアセン化合物となった際にハロゲン基と結合する炭素原子が、水酸基及び水素原子と結合していることを特徴とするポリアセン化合物の製造方法。

[化9]

$$R_1$$
 R_2
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

ただし、化学式(I)中の R_1 、 R_2 、 R_3 , R_4 のうち少なくとも一部は、Tルキル基、Tルケニル基、Tルカニル基等の脂肪族炭化水素基、Tリール基、Tルカニシ基、Tリールオキシ基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシカルボニル基、Tリールオキシル基、T が基、T が表、T がた。T がた。

- (I)中の複数のXのうち一部はハロゲン基であり、他部は水素原子である。さらに、kは1以上5以下の整数である。
- [23] (補正後) 下記の化学式(I)で表されるような構造を有するポリアセン化合物を2段階の反応で製造する方法であって、

1段階目の反応において、下記の化学式(II)で表されるような構造を有するポリアセンキノン誘導体を還元して、下記の化学式(III)で表されるような構造を有するヒドロキシポリアセン誘導体とし、2段階目の反応において、このヒドロキシポリアセン誘導体をハロゲン化及び芳香化することを特徴とするポリアセン化合物の製造方法。

日本国特許庁 12.5.2006

[化10]

[化11]

$$R_1$$
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_2
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_1
 R_2
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4

[化12]

$$R_1$$
 R_2
 R_2
 R_3
 R_4
 R_4
 R_4
 R_4
 R_1
 R_4
 R_4
 R_4
 R_5
 R_4
 R_5
 R_4
 R_5
 R_4
 R_5
 R_6
 R_6
 R_7

ただし、化学式(I),(II),及び(III)中のR₁,R₂,R₃,R₄のうち少なくとも一部は、アルキル基、アルケニル基、アルキニル基等の脂肪族炭化水素基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、エステル基、アルキルオキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルボキシル基、ホルミル基、水酸基、ハロゲン基、アミノ基、イミノ基、アミド基、シアノ基、シリル基、メルカプト基、スルフィド基、ジスルフィド基、スルホニル基、又はこれらのうちの2以上の基を含む官能基であり、他部は水素原子である。

補正された用紙(条約第34条)

また、化学式(I)中の複数のXのうち一部は Λ 口ゲン基であり、他部は水素原子である。さらに、化学式(II)及び化学式(III)中の X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 はそれぞれ Λ 口ゲン基又は水素原子である。ただし、 X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_5 , X_6

さらに、化学式(I)中のkは1以上5以下の整数である。さらに、化学式(II)及び化学式(III)中のmは2以上の整数であり、m+nは3以上7以下の整数である。

- [24] R_3 , R_4 が水素原子であることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [25] R_1 , R_2 と R_3 , R_4 との少なくとも一方は、連結して環状構造を形成していることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [26] R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち官能基の炭素数が 1以上 1 5以下であることを特徴とする請求項 2 2 又は請求項 2 3 に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [27] R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち官能基の炭素数が 2以上 15以下であることを特徴とする請求項 22又は請求項 23に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [28] R_1 , R_2 , R_3 , R_4 のうち官能基の炭素数が 2以上 6以下であることを特徴とする請求項 2 2 又は請求項 2 3 に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [29] 複数のXのうち偶数個がハロゲン基であり、そのうち少なくとも2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [30] 複数のXのうち2個がハロゲン基であり、これら2個のハロゲン基が同一のアセン環に結合していることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載のポリアセン化合物の製造方法。
- [31] kが1又は2であることを特徴とする請求項22又は請求項23に記載のポリアセン 化合物の製造方法。
- [32] 下記の化学式 (IV) で表されるような構造を有するポリアセンに対応する化学構造を 有するヒドロキシポリアセン誘導体であって、同一の六員環数及び同一の $R_1, R_2,$

補正された用紙(条約第34条)